

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004年4月29日 (29.04.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/035423 A1

(51) 国際特許分類⁷: B65D 85/36, H01L 21/04, 21/68

(72) 発明者; および

(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/013236

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 上田 茂明 (UEDA,Shigeaki) [JP/JP]; 〒578-0933 大阪府 東大阪市 玉串元町 1 丁目 11 番 6 号 株式会社大八化成内 Osaka (JP). 渡辺 康行 (WATANABE,Yasuyuki) [JP/JP]; 〒743-0063 山口県 光市 大字島田 3434 番地 ワッカ - エヌエスシー - 株式会社内 Yamaguchi (JP).

(22) 国際出願日: 2003年10月15日 (15.10.2003)

(74) 代理人: 藤芳 寛治, 外 (FUJIYOSHI,Kanji et al.); 〒662-0053 兵庫県 西宮市 松園町 8 番 18 号 藤芳特許事務所 Hyogo (JP).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(81) 指定国 (国内): CN, DE, KR, US.

(26) 国際公開の言語: 日本語

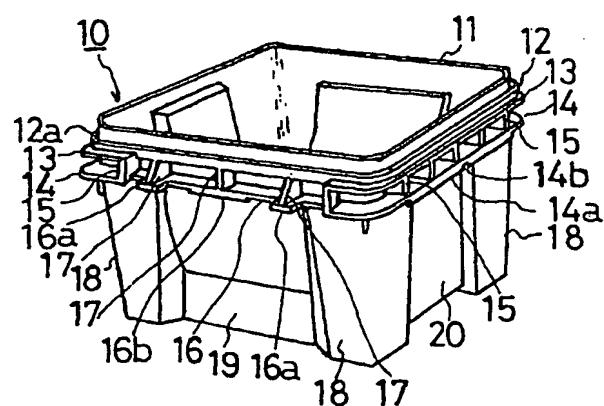
添付公開書類:
— 國際調査報告書

(30) 優先権データ:
特願 2002-302921
2002年10月17日 (17.10.2002) JP

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドノート」を参照。

(54) Title: STORAGE CONTAINER FOR RECEIVING PRECISION SUBSTRATES SUCH AS WAFERS

(54) 発明の名称: ウエハ等精密基板収容容器



(57) Abstract: A storage container for receiving precision substrates such as wafers, having increased strength and improved drying ability when washed. The storage container has a letter L-shaped circumferential wall (12) projectingly provided on an outer wall face, the circumferential wall functioning as a gasket insertion groove (12a). A first flange (13) horizontally extending from the lower end face of the letter L-shaped circumferential wall (12) and a second flange (14) horizontally extending from a position 10-30 mm lower than the first flange are respectively formed integrally with the container. Vertical ribs (15) are formed between the lower face of the first flange (13) and the upper face of the second flange (14).

(57) 要約:

ウエハ等の精密基板収容容器において、外壁面に L 字型周壁 12 を突設してガスケット挿入溝 12a とし、その L 字型周壁 12 の下端面より水平方向に張出す第 1 フランジ 13 と、それより 10 ~ 30 mm 下方にて水平方向に張出す第 2 フランジ 14 とをそれぞれ一体に周設し、その第 1 フランジ 13 の下面と第 2 フランジ 14 の上面間に複数の縦リブ 15 を形成した。強度補強および洗浄時の乾燥性能を向上させることを課題とする。